PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-160243

(43)Date of publication of application: 20.06.1997

(51)Int.CI.

G03F 7/038 G03F 7/027 G03F 7/027 G03F 7/028 G03F 7/032 G03F 7/40 H01J 9/227 H01J 11/02 H01J 17/04

(21)Application number: 07-345613

(71)Applicant: TOKYO OHKA KOGYO CO LTD

(22)Date of filing:

09.12.1995

(72)Inventor: UCHIGAWA KIYOSHI

SHINODA MASARU KOMANO HIROSHI

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION FOR FORMING LIGHT SHIELDING FILM, BLACK MATRIX USING THE SAME AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a black matrix having high heat resistance, excellent in light shielding property, maintaining high image contrast and also having satisfactory electric insulating property.

SOLUTION: This resin compsn. contains a photopolymerizable compd., a photopolymn. initiator and a light shielding material consisting of copper oxide and oxide of at least one kind of metal selected from among Fe, Mn, Cr, Co and Ni. A pattern formed with this compsn. is fired to produce the objective black matrix.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

13.11.2002

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3594392

[Date of registration]

10.09.2004

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-160243

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

(51) Int.CL*		酸別配号	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
G03F	7/038 7/004	505- 501	· ×	G03F		7/038	505 501		
						7/004			
	7/027	501				7/027		501	
		511						511	
	7/028					7/028			
			審查請求	未請求	東京	夏の数 8	FD	(全 7 頁)	最終頁に続く
(21)出廢番号		特膜平7-345613		(71) 出	願人	000220	239		
				.		東京店	化工業	朱式会社	
(22)出顧日		平成7年(1995)12	19日					市中原区中丸	子150番地
				(72)発	明者				
				1.		神奈川	県川崎 i	市中原区中丸	子150番地 東
			ė					式会社内	
	. •		•	(72)発	明者	信太	勝		
		· ·				神奈川	県川崎i	市中原区中丸	子150番地 東
		e e e						式会社内	
				(72)発	明者	駒野	传司		
						神奈川	県川崎	市中原区中丸	子150番地 東
			-					式会社内	
				(74)	理人	弁理士	服部	平八	

【課題】 耐熱性が高く、遮光性に優れ、しかも高い画像 コントラストを維持するとともに電気絶縁性も良好なブラックマトリックス及びそれを形成する遮光膜形成用感 光性樹脂組成物を提供すること。

【解決手段】光重合性化合物、光重合開始剤、及び遮光性材料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物において、前記遮光性材料が銅の酸化物と鉄、マンガン、クロム、コバルト、ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種の金属の酸化物とからなる材料であることを特徴とする遮光膜形成用感光性樹脂組成物、該遮光膜形成用感光性樹脂組成物で形成されたバターンを焼成して得られたブラックマトリックス及びその製造方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】光重合性化合物、光重合開始剤、及び遮光性材料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物において、前記遮光性材料が銅の酸化物と鉄、マンガン、クロム、コパルト、ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種の金属の酸化物とからなる材料であることを特徴とする遮光膜形成用感光性樹脂組成物。

【請求項2】 遮光性材料が銅の酸化物と鉄及びマンガンの酸化物とからなる請求項1 記載の遮光膜形成用感光性 樹脂組成物。

【請求項3】 遮光性材料の平均粒子径が0.01~5μ mの範囲にあることを特徴とする請求項1記載の遮光膜 形成用感光性樹脂組成物。

【請求項4】請求項1記載の遮光膜形成用感光性樹脂組成物にさらに低融点ガラスが含有することを特徴とする 遮光膜形成用感光性樹脂組成物。

【請求項5】請求項1又は4記載の遮光膜形成用感光性 樹脂組成物にさらに塗膜形成能を有する高分子化合物を 含有することを特徴とする遮光膜形成用感光性樹脂組成 物。

【請求項6】光重合性化合物、光重合開始剤、及び飼の酸化物と鉄、マンガン、クロム、コバルト、ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種の金属の酸化物とからなる遮光性材料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物を用いて形成した金属酸化物層からなるプラックマトリックス。

【請求項7】ブラックマトリックスの光学濃度がOD値で1.5以上、電気絶縁抵抗値が1×10⁸Q/口以上であることを特徴とする請求項5記載のブラックマトリックス。

【請求項8】基板上に光重合性化合物、光重合開始剤、及び銅の酸化と鉄、マンガン、クロム、コバルト、ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種の金属の酸化物とからなる遮光性材料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物を塗布、乾燥し、それに活性光線を選択的に照射したのち、現像してパターンを形成し、それを350~750℃の温度で焼成することを特徴とするプラックマトリックスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規な遮光膜形成 用感光性樹脂組成物、該組成物で形成したブラックマト リックス、及びその製造方法、さらに詳しくはブラズマ ディスプレイ等のブラックマトリックスの形成に好適 な、耐熱性及び電気絶縁性が高く、しかも遮光性に優れ たブラックマトリックスを形成できる遮光膜形成用感光 性樹脂組成物、該遮光膜形成用感光性樹脂組成物を用い て形成したブラックマトリックス、及びその製造方法に 関する。

[0002]

【従来技術】従来より、CRTディスプレイや液晶パネ ル等の表示体の製造において、画像のコントラストを強 調するためプラックマトリックスが形成されているが、 その形成にカーボンブラックを含有する遮光膜形成用感 光性樹脂組成物が用いられてきた。ところが、近年、デ ィスプレイとしてプラズマディスプレイ(以下「PD P」という)がCRTディスプレイと同程度の発光輝度 を有する表示体が得られる上に、構造が比較的簡単で大 型化が可能であるとともに装置もコンパクトにできるこ とから注目を集め、そのPDPのプラックマトリックス の形成に上記CRTディスプレイや液晶パネル等のブラ ックマトリックスの形成に使用されている遮光膜形成用 感光性樹脂組成物の使用が期待された。しかしPDPの 製造においては350~750℃の焼成工程があり、こ の工程で前記遮光膜形成用感光性樹脂組成物中に含有す るカーボンプラックが分解し、満足できるブラックマト リックスの形成が困難であった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そこで、上記欠点を解決するするため、カーボンプラックの代わりにチタンプラックなどの耐熱性を有する無機顔料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物が提案されたが、チタンプラックを含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物はカーボンプラックを主体とした遮光膜形成用感光性樹脂組成物に比べ形成されるプラックマトリックスの遮光性が低く、無彩色の満足するプラックマトリックスの形成ができなかった

【0004】こうした現状に鑑み、本発明者等は鋭意研究した結果、特定の金属酸化物からなる遮光性材料を感光性樹脂組成物に含有させることで、高い耐熱性を有するとともに、遮光性に優れ、しかも電流のリークのないブラックマトリックスが形成できることを見い出し、本発明を完成したものである。すなわち

【0005】本発明は、耐熱性が高く、遮光性に優れた プラックマトリックスを形成する遮光膜形成用感光性樹 脂組成物を提供することを目的とする。

【0006】また、本発明は、耐熱性が高く、遮光性が 優れるとともに、電流リークのないプラックマトリック スを提供することを目的とする。

【0007】さらに、本発明は、上記ブラックマトリックスの製造方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明は、光重合性化合物、光重合開始剤、及び遮光性材料を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物において、前記遮光性材料が銅の酸化物と鉄、マンガン、クロム、コパルト、ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種の金属の酸化物とから遮光性材料であることを特徴とする遮光膜形成用感光性樹脂組成物、該組成物を用いて形成したブラックマトリックス、及びその製造方法に係

る。

【0009】上記本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成 物の成分である光重合性化合物としては、エチレン性ニ 重結合を有する光重合性化合物が好ましく、具体的に は、アクリル酸、メタクリル酸、フマル酸、マレイン 酸、フマル酸モノメチル、フマル酸モノエチル、2-ヒ ドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルメ タクリレート、エチレングリコールモノメチルエーテル アクリレート、エチレングリコールモノメチルエーテル メタクリレート、エチレングリコールモノエチルエーテ ルアクリレート、エチレングリコールモノエチルエーテ ルメタクリレート、グリセロールアクリレート、グリセ ロールメタクリレート、アクリル酸アミド、メタクリル 酸アミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、メ チルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアク リレート、エチルメタクリレート、イソプチルアクリレ ート、イソプチルメタクリレート、2-エチルヘキシル アクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、ベ ンジルアクリレート、ベンジルメタクリレート、エチレ ングリコールジアクリレート、エチレングリコールジメ タクリレート、トリエチレングリコールジアクリレー ト、トリエチレングリコールジメタクリレート、テトラ エチレングリコールジアクリレート、テトラエチレング リコールジメタクリレート、プチレングリコールジメタ クリレート、プロピレングリコールジアクリレート、プ ロピレングリコールジメタクリレート、トリメチロール プロパントリアクリレート、トリメチロールプロパント リメタクリレート、テトラメチロールプロパンテトラア クリレート、テトラメチロールプロパンテトラメタクリ レート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ペン タエリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリ トールテトラアクリレート、ペンタエリスリトールテト ラメタクリレート、ジベンタエリスリトールベンタアク リレート、ジペンタエリスリトールペンタメタクリレー ト、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート、ジベ ンタエリスリトールヘキサメタクリレート、1,6-ヘ キサンジオールジアクリレート、1、6-ヘキサンジオ ールジメタクリレート、カルドエポキシジアクリレート 等のモノマー、オリゴマー類;多価アルコール類と1塩 基酸または多塩基酸を縮合して得られるポリエステルブ レポリマーに(メタ)アクリル酸を反応して得られるポ リエステル (メタ) アクリレート、ポリオール基と 2 個 のイソシアネート基を持つ化合物を反応させた後、 (メ タ) アクリル酸を反応して得られるポリウレタン (メ タ) アクリレート: ピスフェノールA型エポキシ樹脂、 ビスフェノールF型エポキシ樹脂、ビスフェノールS型 エポキシ樹脂、フェノールまたはクレゾールノボラック 型エポキシ樹脂、レゾール型エポキシ樹脂、トリフェノ ールメタン型エポキシ樹脂、ポリカルボン酸ポリグリシ ジルエステル、ポリオールポリグリシジルエステル、脂

肪族または脂環式エポキシ樹脂、アミンエポキシ樹脂、ジヒドロキシベンゼン型エポキシ樹脂などのエポキシ樹脂と (メタ) アクリル酸を反応して得られるエポキシ (メタ) アクリレート樹脂などが挙げられる。さらに前 記エポキシ (メタ) アクリレート樹脂に多塩基酸無水物を反応させた樹脂も好適に使用できる。

【0010】上記光重合性化合物は、該化合物と光重合開始剤の合計100重量部に対し60~99.9重量部の範囲で含有される。含有量が60重量部未満では十分な耐熱性、耐薬品性が期待できず、また99.9重量部を超えると強膜形成能が劣り、光硬化不良を起こすことがある。

【0011】また、光重合開始剤としては、具体的に1 ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、2,2-ジメトキシー1, 2-ジフェニルエタン-1-オン、2 ーメチルー1ー [4ー (メチルチオ) フェニル] ー2ー モルフォリノプロパン-1-オン、2-ペンジル-2-ジメチルアミノー1ー (4ーモルフォリノフェニル) ー プタン-1-オン、2-ヒドロキシ-2-メチル-1-フェニルプロパン-1-オン、2, 4, 6-トリメチル ベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、1-[4-(2-ヒドロキシエトキシ) フェニル] -2-ヒドロキ シー2-メチルー1-プロパン-1-オン、2,4-ジ エチルチオキサントン、2-クロロチオキントン、2、 4-ジメチルチオキサントン、3,3-ジメチル-4-メトキシベンプフェノン、ベンソフェノン、1ークロロ -4-プロポキシチオキサントン、1-(4-イソプロ ピルフェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン -1-オン、1-(4-ドデシルフェニル)-2-ヒド ロキシー2ーメチルプロパン-1-オン、4-ペンソイ ルー4'ーメチルジメチルスルフィド、4ージメチルア ミノ安息香酸、4-ジメチルアミノ安息香酸メチル、4 ージメチルアミノ安息香酸エチル、4 ージメチルアミノ 安息香酸プチル、4ージメチルアミノ安息香酸-2-エ チルヘキシル、4ージメチルアミノ安息香酸-2-イソ アミル、2,2-ジエトキシアセトフェノン、ベンジル ジメチルケタール、ペンジルーβ-メトキシエチルアセ タール、1-フェニルー1, 2-プロパンジオン-2-(o-エトキシカルボニル) オキシム、o-ベンソイル 安息香酸メチル、ビス (4-ジメチルアミノフェニル) ケトン、4,・4'ーピスジエチルアミノベンソフェノ ン、4,4'ージクロロベンソフェノン、ベンジル、ペ ンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチ ルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンソ インーnープチルエーテル、ベンソインイソプチルエー テル、ベンソインブチルエーテル、pージメチルアミノ アセトフェノン、p-tert-ブチルトリクロロアセ トフェノン、pーtertープチルジクロロアセトフェ ノン、チオキサントン、2-メチルチオキサントン、2 ーイソプロピルチオキサントン、ジベンソスベロン、

α, αージクロロー4ーフェノキシアセトフェノン、ペンチルー4ージメチルアミノベンゾエート、9ーフェニルアクリジン、1, 7ーピスー (9ーアクリジニル) ペプタン、1, 5ーピスー (9ーアクリジニル) ペンタン、1, 3ーピスー (9ーアクリジニル) プロパン、2, 4ーピスートリクロロメチルー6ー (3ープロモー4ーメトキシ) フェニルーsートリアジン、2, 4ーピスートリクロロメチルー6ー (2ープロモー4ーメトキシ) フェニルーsートリアジン、2, 4ーピスートリクロロメチルー6ー (3ープロモー4ーメトキシ) スチリルフェニルーsートリアジンなどが挙げられる。

【0012】上記光重合開始剤は、光重合性化合物及び 光重合開始剤の合計100重量部中0.1~40重量部 の範囲で含有することができる。

【0013】上記成分に加えて本発明の遮光膜形成用感 光性樹脂組成物は、銅の酸化物と鉄、クロム、コバル ト、ニッケルの群から選択してなる少なくとも1種の金 属の酸化物とからなる遮光性材料を含有することを必須 とする。前記遮光性材料としては、具体的に Fe_2O_3 ・ CuO, Fe₃O₄·CuO, MnO₂·CuO, CuO ·Cr2O3, CuO·CoO, CuO·NiO, Fe2 O3·MnO2·CuO, Fe3O4·MnO2·CuO, MnO₂·CuO·Cr₂O₃, MnO₂·CuO·Co O, MnO2 · CuO · NiO, Fe2O3 · Fe3 O4 ·MnO₂·CuO, Fe₂O₃·Fe₃O₄·MnO₂·C uO·Cr₂O₃, Fe₂O₃·Fe₃O₄·MnO₂·Cu $O \cdot C \circ O$, $F e_2 O_3 \cdot F e_3 O_4 \cdot Mn O_2 \cdot C u O \cdot$ NiO、Fe₂O₃·Fe₃O₄·MnO₂·CuO·Cr₂ O₃·CoO, Fe₂O₃·Fe₃O₄·MnO₂·CuO· $Cr_2O_3 \cdot NiO_* Fe_2O_3 \cdot Fe_3O_4 \cdot MnO_2 \cdot C$ uO・Cr₂O₃・CoO・NiOなどを挙げることがで きるが、これらに限定されるものではない。中でも、F e₂O₃·MnO₂·CũO、Fe₃O₄·MnO₂·Cu O, Fe₂O₃·Fe₃O₄·MnO₂·CuO, Fe₂O₃ \cdot F $e_3O_4 \cdot MnO_2 \cdot CuO \cdot Cr_2O_3$, F $e_2O_3 \cdot$ Fe3O4·MnO2·CuO·CoO, Fe2O3·Fe3 O4·MnO2·CuO·NiO、Fe2O3·Fe3O4· MnO2 · CuO · Cr2O3 · CoO, Fe2O3 · Fe3 O₄·MnO₂·CuO·Cr₂O₃·NiO、Fe₂O₃· Fe₃O₄·MnO₂·CuO·Cr₂O₃·CoO·Ni Oなど、銅酸化物と鉄及びマンガンの酸化物の組合せを 含む遮光性材料が好ましい。

【0014】上記遮光性材料はその平均粒子径が0.01~5µmの範囲が好ましく、前記範囲を逸脱するとブラックマトリックスの可視光線に対する遮光性能が低下する。前記遮光性材料は有機溶剤を除く光重合性化合物と光重合開始剤との総和100重量部に対し、10~600重量部の範囲で含有することができる。

【0015】また、銅の酸化物と鉄、マンガン、クロム、コパルト、ニッケルの群から選択してなる少なくとも1種の金属の酸化物との配合重量比は1:20~10:1、好ましくは1:9~6:1程度がよい。この配合重量比が1:20~10:1の範囲から外れた場合、無彩色のプラックマトリックスパターンが得られないことがある。

【0016】さらに、本発明の遮光膜形成用感光性樹脂 組成物は、基板への塗布、乾燥時に、タック性の少ない 乾燥した被膜を形成でき、かつ遮光膜の強度を上げるた め塗膜形成能を有する高分子化合物を含有することがで きる。前記高分子化合物としては、具体的にアクリル 酸、メタクリル酸、アクリル酸メチル、メタクリル酸メ チル、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチル、2-ヒ ドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルメ タクリレート、2ーヒドロキシプロピルメタクリレー ト、Nープチルアクリレート、Nープチルメタクリレー ト、イソプチルアクリート、イソプチルメタクリレー ト、ベンジルアクリレート、ベンジルメタクリレート、 フェノキシアクリレート、フェノキシメタクリレート、 イソポルニルアクリレート、イソボルニルメタクリレー ト、スチレン、アクリルアミド、アクリロニトリル等の 共重合物が挙げられる。特に遮光膜形成用感光性樹脂組 成物がアルカリ現像可能となるようにアクリル酸、メタ クリル酸を共重合成分中に5~40重量%程度含有させ た共重合体が好ましい。またカルボキシメチルセルロー ス、カルボキシエチルセルロース、カルボキシプロピル セルロースなどのセルロース樹脂、及びヒドロキシメチ ルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキ シプロピルセルロースなどのヒドロキシル基に多塩基酸 無水物が反応したセルロース樹脂も好適に使用できる。 【0017】上記塗膜形成能を有する高分子化合物は、 光重合性化合物及び光重合開始剤の合計100重量部中 20~200重量部の範囲で含有されるのがよい。 【0018】本発明の遮光形成感光性樹脂組成物は、さ らに遮光膜の色調や遮蔽性能を向上させるために、鉛 白、亜鉛華、酸化チタン、塩基性硫酸塩、リトポン、硫 酸亜鉛、チタン酸鉛、酸化ジルコニウム、バライト、沈 降性硫酸パリウム、炭酸パリウム、白亜、沈降性炭酸カ ルシウム、石膏、炭酸マグネシウム、アルミナ、クレ 一、滑石紛、ケイ草土、鉛丹、朱、カドミウム赤、黄 鉛、カドミウム黄、亜鉛黄、ストロンチウム黄、バリウ ム黄、エメラルド緑、カドミウム緑、シリカ、タルク、 パナジウム錫黄、パナジウムジルコニウム黄、プラセオ ジム黄、アンチモン錫青、ライラックなどの他の無機顔 料を添加することができる。また、ホウ酸鉛ガラス、ホ ウ酸亜鉛ガラスなどSi、B、Pb、Na、K、Mnの

酸化物からなる低融点ガラスも添加できる。前記低融点:

し、強固なブラックマトリックスを形成することができ

ガラスは焼成処理時に金属酸化物の結着剤として作用

る.

【0019】本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成物に は、必要に応じて遮光膜形成用感光性樹脂組成物を希釈 するための有機溶剤、熱重合禁止剤、消泡剤、界面活性 剤などが添加できる。前記有機溶剤としては、具体的に はペンゼン、トルエン、キシレン、メチルエチルケト ン、アセトン、メチルイソプチルケトン、シクロヘキサ ノン、メタノール、エタノール、プロパノール、プタノ ール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、エチレング リコール、ジエチレングリコール、グリセリン、エチレ ングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコール モノエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチル エーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール ジメチルエーテル、ジェチレングリコールジェチルエー テル、3ーメトキシブチルアセテート、3ーメチルー3 ーメトキシプチルアセテート、プロピレングリコールモ ノメチルエーテルプロピオネート、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルプロピオネート、炭酸メチル、炭 酸エチル、炭酸プロビル、炭酸プチルなどが挙げられ る。中でも3-メトキシブチルアセテートは遮光膜形成 用感光性樹脂組成物中の可溶成分に対して優れた溶解性 を示すのみならず、顔料などの不溶性成分の分散性を良 好にするところから好適である。前記有機溶剤は光重合 性化合物、光重合開始剤および遮光性材料の合計100 重量部に対して50~500重量部の範囲で用いること ができる。また、熱重合禁止剤としてはヒドロキノン、 ヒドロキノンモノエチルエーテル等が、消泡剤としては シリコーン系、フッ素系化合物が、界面活性剤としては アニオン系、カチオン系、ノニオン系等の従来公知の各 種熱重合禁止剤が、さらに消泡剤としての界面活性剤が 添加できる。

【0020】本発明のブラックマトリックスは、上記各成分を含有する遮光膜形成用感光性樹脂組成物を用いてフォトリソグラフ法でパターンを形成し、それを焼成することで形成されるが、その遮光率は光学濃度で〇D値1.5以上、好ましくは2.0以上、電気絶縁抵抗値は1×10⁸Q/□以上であることを必要とする。前記遮光率以上を有することで本発明のブラックマトリックスは表示体として高コントラストの画像が維持でき、またその電気絶縁抵抗値が前記数値以上であることにより電流リークのない表示体が作成できる。

【0021】上記プラックマトリックスの製造方法は以下のとおりである。すなわち

(i) 遮光膜形成用感光性樹脂組成物の調製 光重合性化合物、光重合開始剤、銅の酸化物と鉄、マン ガン、クロム、コパルト、ニッケルの群から選択してな る少なくとも1種の金属の酸化物とからなる遮光性材 料、並びに必要により露膜形成能を有する高分子化合 物、有機溶剤、熱重合禁止剤、消泡剤、界面活性剤等を 3本ロールミル、ボールミル、サンドミル等でよく分 散、混練して遮光膜形成用感光性樹脂組成物を調製す る。

【0022】 (i i) 遮光膜形成用感光性樹脂組成物の 塗布

ソーダライムガラス、低膨張ガラス、ノンアルカリガラス、石英ガラス等のガラス基板、1TO電極が形成されたガラス基板などの表面を清浄し、その上に(i)で調製した遮光膜形成用感光性樹脂組成物を塗布する。塗布に当たっては基板と感光性樹脂組成物との密着性を向上させるためシランカップリング剤を感光性樹脂組成物に配合するか、或は予め基板に塗布しておいてもよい。前配塗布はロールコーター、リバースコーター、バーコーター等の接触転写型塗布装置やスピンナー、カーテンマローターの接触転写型塗布装置を用いて行う。特に厚膜の形成の場合には複数回塗布するか、室温にてターロ膜の形成の場合には複数回塗布するか、室温にて多いの場合には複数回塗布を、室温にてターに数十分で数時間入れて溶剤を除去し、塗布膜厚1~10μm程度に調整する。

【0023】 (i i i) 露光処理

上記塗布膜にネガマスクを介して、露光を行う。露光に用いる活性エネルギー線としては紫外線、エキシマレーザー光、エックス線、ガンマ線、電子線が好適である。服射エネルギー線量は用いる感光性樹脂組成物の組成に応じて若干変わるが30~200mJ/cm²の範囲で選択される。

【0024】 (iv) 現像処理

露光後、現像液を用いて浸漬法、スプレー法等により現 像する。現像液としては、リチウム、ナトリウム、カリ ウム等アルカリ金属の水酸化物、炭酸塩、重炭酸塩、リ ン酸塩、ピロリン酸塩、ベンジルアミン、プチルアミン 等の第1級アミン、ジメチルアミン、ジベンジルアミ ン、ジエタノールアミン等の第2級アミン、トリメチル アミン、トリエチルアミン、トリエタノールアミン等の 第3級アミン、モルホリン、ピペラジン、ピリジン等の 環状アミン、、エチレンジアミン、ヘキサメチレンジア ミン等のポリアミン、テトラエチルアンモニウムヒドロ キシド、トリメチルペンジルアンモニウムヒドロキシ ド、トリメチルフェニルベンジルアンモニウムヒドロキ シド等のアンモニウムヒドロキシド類、トリメチルスル ホニウムヒドロキシド、ジエチルメチルスルホニウムヒ ドロキシド、ジメチルベンジルスルホニウムヒドロキシ ド等のスルホニウムヒドロキシド類、その他コリン等の 水溶液が使用される。

【0025】(v)焼成処理

本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成物を液晶パネル等 のプラックマトリックス形成に用いる場合には、(i v)の現像処理により完成することができるが、プラズ マディスプレイパネルのブラックマトリックスの形成においては焼成作業が必要となる。前記プラズマディスプレイパネルのブラックマトリックスは上記現像処理した基板を350~750℃の温度で焼成し、遮光膜形成用感光性樹脂組成物中の金属の酸化物等の無機物以外を熱分解し、揮散し、無機物の遮光層に形成して製造される。

[0026]

【発明の実施の形態】次に本発明の実施例について述べるがこれによって本発明はなんら限定されるものではない。

[0027]

【実施例】

実施例1

下記に示される化合物をよくかきまぜ遮光膜形成用感光 性樹脂組成物を調製した。

Fe₂O₃·MnO₂·CuO(重量比、Fe₂O₃:MnO₂

: CuO = 1 : 1 : 1)

40 重量部

メタクリル酸/メタクリル酸メチル共重合体

(25/75重量%比、重量平均分子量約25000)

15重量部

トリメチロールプロパントリアクリレート

9 重量部

2-ベンジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-

モルフォリノフェニル) ープタン-1-オン (チバガイギー社製: IRGACURE 369)

2重量部

ジエチルチオキサントン

2重量部

3-メトキシブチルアセテート

55重量部

を3本ロールミルを用いて2時間分散、混練した。 【0028】得られた遮光膜形成用感光性樹脂組成物を 厚さ3mmの清浄な表面を有するガラス基板上にリバー スコーター (大日本スクリーン社製:ラウンドコータ 一)を用いて乾燥膜厚2μmとなるように塗布し80℃ で1分間乾燥させた。その後、800mJ/cm2の紫 外線を全面照射して露光したのち、電気炉中で540 ℃、30分間焼成作業を行った。この基板に背面から3 波長蛍光管の光を照射したが、色ムラ等のない優れた黒 色フイルタが得られた。遮光性を示すOD値は、測定器 「PDA-65」 (コニカ社製) を用いて測定したとこ ろ、2.5であった。また、測定器として「ハイレス タ」(三菱化学社製)を使用し、電気絶縁抵抗値を測定 したところ8. 51×10°Ω/口であった。同様にし て遮光膜形成用感光性樹脂組成物を塗布、乾燥したガラ ス基板上にネガマスクを介して露光し、2%炭酸ナトリ

ウム水溶液を用いて、25℃、90秒間現像し、焼成を 行ったが、露光部にカケ、ハガレ、変色等がみられず、 未露光部にも残渣のない良好なブラックマトリックスが 得られた。

【0029】比較例1

実施例1の Fe_2O_3 ・ MnO_2 ・CuO40重量部の代わりに、カーボンブラック4O重量部使用した以外はすべて同様にして、得られた遮光膜形成用感光性樹脂組成物をガラス基板上に乾燥膜 $\mathbf{2}\,\mu$ mとなるように塗布し、乾燥後、 $800\,\mathrm{mJ/cm^2}$ の紫外線を全面照射して**欧**光し、電気炉中で $540\,\mathrm{C}$ 、30分間焼成作業を行った。カーボンブラックが分解、酸化してしまい、基板上に残ってはいなかった。

【0030】実施例2

下記に示される化合物をよくかきまぜ遮光膜形成用感光 性樹脂組成物を調製した。

Cr₂O₃·CoO·CuO(重量比、Cr₂O₃:CoO

: CuO = 3 : 2 : 1)

10重量部

メタクリル酸/メタクリル酸メチル共重合体

15重量部

(25/75重量%比、重量平均分子量約25000) トリメチロールプロパントリアクリレート

9 重量部

2-ベンジルー2-ジメチルアミノー1-(4-

モルフォリノフェニル) ープタンー1ーオン (前出)

2重量部 2重量部

ジエチルチオキサントン

3-メトキシプチルアセテート

55重量部

を3本ロールミルを用いて2時間分散、混練した。 【0031】得られた遮光膜形成用感光性樹脂組成物を厚さ3mmの清浄な表面を有するガラス基板上にリバースコーター(前出)を用いて乾燥膜厚2μmとなるように塗布し80℃で1分間乾燥させた。その後、800mJ/cm²の紫外線を全面照射して露光したのち、電気炉中で540℃、30分間焼成作業を行った。この基板 に背面から3波長蛍光管の光を照射したが、色ムラ等のない優れた黒色フイルタが得られた。遮光性を示すOD値は、測定器「PDA-65」(前出)を用いて測定したところ、1.8であった。また、測定器として「ハイレスタ」(前出)を使用し、電気絶縁抵抗値を測定したところ5.38×10¹¹Q/口であった。同様にして遮光膜形成用感光性樹脂組成物を塗布、乾燥したガラス基

板上にネガマスクを介して露光し、2%炭酸ナトリウム 水溶液を用いて、25℃、90秒間現像し、焼成を行っ たが、露光部にカケ、ハガレ、変色等がみられず、未露 光部にも残渣のない良好なプラックマトリックスが得ら

れた。

【0032】実施例3

下記に示される化合物をよくかきまぜ遮光膜形成用感光 性樹脂組成物を調製した。

Fe₂O₃·NiO₂·CuO (重量比、Fe₂O₃:NiO₂ : CuO = 3:3:1)50重量部 メタクリル酸/メタクリル酸メチル共重合体 (25/75 重量%比、重量平均分子量約25000) 15重量部 トリメチロールプロパントリアクリレート 9 重量部 2-ペンジルー2ージメチルアミノー1ー(4-モルフォリノフェニル) ープタンー1ーオン (前出) 2 重量部

ジエチルチオキサントン

2 重量部

3-メトキシブチルアセテート

55重量部

を3本ロールミルを用いて2時間分散、混練した。

【0033】得られた遮光膜形成用感光性樹脂組成物を 厚さ3mmの清浄な表面を有するガラス基板上にリバー スコーター(前出)を用いて乾燥膜厚3μmとなるよう に塗布し80℃で1分間乾燥させた。その後、800m J/cm²の紫外線を全面照射して露光したのち、電気 炉中で540℃、30分間焼成作業を行った。この基板 に背面から3波長蛍光管の光を照射したが、色ムラ等の ない優れた黒色フイルタが得られた。遮光性を示すOD 値は、測定器「PDA-65」(前出)を用いて測定し たところ、2.8であった。また、測定器として「ハイ レスタ」(前出)を使用し、電気絶縁抵抗値を測定した ところ2.84×10°Q/口であった。同様にして遮 光膜形成用感光性樹脂組成物を塗布、乾燥したガラス基 板上にネガマスクを介して露光し、2%炭酸ナトリウム 水溶液を用いて、25℃、90秒間現像し、焼成を行っ

たが、露光部にカケ、ハガレ、変色等がみられず、未露 光部にも残渣のない良好なブラックマトリックスが得ら れた。

[0034]

【発明の効果】本発明の遮光膜形成用感光性樹脂組成物 は、銅の酸化物と鉄、マンガン、クロム、コパルト、ニ ッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種の金属の 酸化物とからなる遮光材料を含有する遮光膜形成用感光 性樹脂組成物であって、焼成により容易に前記材料を主 とした無機質の遮光層が形成される感光性樹脂組成物で ある。前記遮光膜形成用感光性樹脂組成物を用いて形成 したプラズマディスプレイパネルのプラックマトリック スは、耐熱性が高く、遮光性に優れ、しかも高い面像コ ントラストを維持とともに電気絶縁性も良好で、電流の リークのないプラックマトリックスである。

フロントページの続き・

	• • • •		•	`.		
(51) Int. Cl. ⁶		職別記号 庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G03F	7/032		G03F	7/032	•• •	
	7/40	501	•	7/40	501	
H01J	9/227	•	H01J	9/227	D	
	11/02			11/02	· B	
	17/04		•	17/04		